

財團法人工業技術研究院 函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：劉珈瑛

電話：03-5917469

傳真：03-5820466

E-mail：itri533591@itri.org.tw



108000683507

110 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會

發文日期：中華民國 108 年 04 月 25 日

發文字號：工研轉字第 1080006835 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：有關本院「光學檢測相關專利非專屬授權案」，敬請轉知
貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，
請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將辦理光學檢測相關專利(5 案 9 件)之非專屬授權活動(詳如附件)。
- 二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：
 - (一) 工研院研發成果公告網站 (<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>)
 - (二) 台灣技術交易資訊網 (<https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx>)。
- 三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 四、公開說明會：
 - (一) 舉辦時間：民國(下同) 108 年 5 月 10 日下午 15 時至 16 時。

(二) 舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 5 月 9 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「光學檢測相關專利非專屬授權案」公開說明會報名」，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。

五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 劉小姐

電話：(03)591-7469

傳真：(03)582-0466

電子信箱：itri533591@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣電子設備協會

院長 

依權責劃分規定授權業務主管執行



財團法人工業技術研究院

光學檢測相關專利非專屬授權案

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、非專屬授權標的：光學檢測相關專利 5 案 9 件，詳如下述網站：

（一）工研院研發成果公告網：

<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>

（二）台灣技術交易資訊網(TWTM)：

<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>

三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：民國（下同）108 年 5 月 10 日下午 15 時至 16 時。

（二）舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 5 月 9 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「光學檢測相關專利非專屬授權案公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）。

五、聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 劉小姐

電話：(03) 591-7469

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：itri533591@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：授權標的清單 (5 案 9 件)

技術類別	案次	案編號	件次	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請號	專利證號	獨有 共有	專利 起期	專利 迄期	委辦 單位
光學 檢測 (5 案 9 件)	1	P07950015	1	P07950015TW	表面電漿共振檢測 裝置及檢測方法	TW	獲證	95149149	I322887	獨有	2010 0401	2026 1226	經濟部 技術處
			2	P07950015US		US	獲證	11/760,356	7,663,758	獨有	2010 0216	2028 0719	經濟部 技術處
	2	P07960005	3	P07960005CN	多通道光譜量測裝 置與相位差解析方 法	CN	獲證	2007101887 07.X	ZL20071018 8707.X	獨有	2010 1229	2027 1114	經濟部 技術處
			4	P07960005TW		TW	獲證	96136839	I340237	獨有	2011 0411	2027 1001	經濟部 技術處
	3	P07960024	5	P07960024CN	光學式非球面測量 系統及其平台	CN	獲證	2007101520 71.3	ZL20071015 2071.3	獨有	2011 0126	2027 1008	經濟部 技術處
			6	P07960024TW		TW	獲證	96137645	I340234	獨有	2011 0411	2027 1007	經濟部 技術處
	4	P07970031	7	P07970031TW	雙面光學片滾壓對 位量測系統及其方 法	TW	獲證	97147100	I381255	獨有	2013 0101	2028 1203	經濟部 技術處
			8	P07970031US		US	獲證	12/571,961	8,223,335	獨有	2012 0717	2030 1217	經濟部 技術處
	5	P07980022	9	P07980022TW	雙面光學膜片量測 裝置與方法	TW	獲證	98143293	I408331	獨有	2013 0911	2029 1216	經濟部 技術處

※本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利申請範圍內之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。